



△×				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料	-	CHAMFER 一般面取	-	QUANTITY 個数	
△×				T. A.	T. A.	TREATMENT 処理	-	FINISHING 仕上	-		
△×						TREATMENT CONTACT 処理接点	-	DECENTRATION 偏芯	-		
△×				DESIGNED	DRAWN	OVER 250 UP TO 1000	±0.3 ±0.5 ±1.0 ±0.2	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用 (機種名)	
△×				H. M.	H. M.	OVER 63 UP TO 250	±0.2 ±0.3 ±0.6 ±0.15	UNIT (mm)		VS-HX5035	
△× 2	彫刻(最小絞り)ヲ変更、Fマウントヲ除去	20.03.25	H. M.			OVER 16 UP TO 63	±0.1 ±0.2 ±0.4 ±0.1	SCALE			1 / 1
NO.×箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			OVER 0 UP TO 16	±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.1	DATE	'19.11.20	DRAW NO.	01D S V 0 1 9 0 A 2
						TOLERANCES	A B C S				